

TFL2100
シリーズ

非接触平面度測定装置

new



低価格

回転軸エアースピンドル

ベースに石定盤使用

重量物の測定に対応

特長

- ・ 低価格にて高精度な測定を実現
- ・ データ収集が高速
- ・ 非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- ・ 測定対象物による影響が非常に少ない
- ・ **重量物の測定が可能**
- ・ **驚異的な面振れ精度を実現**
- ・ ご使用の対象物形状に合わせてシステム構築が可能
(ご相談下さい)

用途

- ・ 樹脂の加工板やガラス基板の平面度測定
- ・ ステンレスやチタン、アルミ、鉄板などの金属板の平面度測定
- ・ また、金型などの重量物の平面度測定

・仕様

レーザー変位センサ		
基準距離		10mm
測定範囲		±1mm
測定方式		三角測距式
光源	レーザー	半導体レーザー
	波長	650nm 可視光CLAS1
	出力	0.3mW
センサ部移動量	Z軸ステージ(手動、固定式)	±45mm
XY軸部	移動量	X=380mm(MAX) Y=400mm(MAX)
	最小送り量	2μm/STEP
	最高移動速度	100mm/SEC
	位置決め精度	10μm以内
	繰り返し位置決め精度	±2μm以内
	バックラッシュ・ロストモーション	5μm以内
θ軸部	回転量	360°
	最小送り量	0.0036/STEP
	最高回転速度	10rpm (測定速度)
	テーブル面	φ600
	耐荷重	200Kg
	位置決め精度	10μm以内
	繰り返し振れ精度	5μm以下(φ600円周上)
制御部	パソコン	PC/AT互換機
	ステージドライバ	
	アナログ部	
	USB/F	USB1.1/2.0
	外形・重量	約 W433×H140×D255 7Kg以下
データ処理	測定データ量	5000データ/回転×20(MAX)
ソフトウェア	平面度測定専用プログラム	OS Windows2000,XP,7対応

この仕様以外に、測定したいワークの形状や、小さいものから大きいものまで対応可能ですのでご相談ください。

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。